

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-221989

(43)公開日 平成 6 年(1994) 8 月12日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 1 N 15/14	P	6928-2 J		
15/02	A	6928-2 J		
21/53	Z	7370-2 J		

審査請求 未請求 請求項の数 1 F D (全 9 頁)

(21)出願番号 特願平5-32817

(22)出願日 平成 5 年(1993) 1 月27日

(71)出願人 000115636

リオン株式会社

東京都国分寺市東元町 3 丁目20番41号

(72)発明者 持地 秀明

東京都国分寺市東元町 3 丁目20番41号リオン株式会社内

(72)発明者 阿部 孝

東京都国分寺市東元町 3 丁目20番41号リオン株式会社内

(74)代理人 弁理士 田辺 恵基

(54)【発明の名称】 光散乱式微粒子検出装置

(57)【要約】

【目的】レーザ光源を安定動作させることにより粒子検出精度を向上させる。

【構成】レーザ光源3から出射する光源光LA1をフローセル2に入射させる構成として、戻り光LA11及びLA12がレーザ光源3に戻らないようにフローセル2を傾けるように位置決めする。かくして比較的大きい光エネルギーを有する光源光LA1が反射することにより生ずる戻り光LA11及びLA12の影響を受けないようにレーザ光源3の出力を安定化することができることにより、異常カウント動作をさせないようにできる。

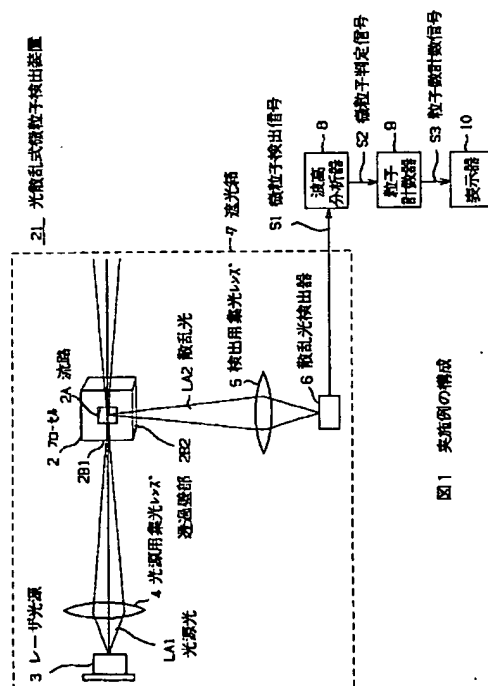


図1 実施例の構成